

公益社団法人応用物理学会 集積化 MEMS 技術研究会

The study group of the integrated MEMS

集積化 MEMS 技術研究会

委員長 秦 誠一

名古屋大学

-集積化 MEMS 技術研究会-

平成 20 年 5 月 16 日に応用物理学会にて承認を受け本研究会が設立しました。これまでに多くの企画を開催し、多くの方の参加と活発な議論がありました。下記HPにお越しくださいませ。是非ご覧いただければと思います。尚、研究会の会員であれば、過去の講演の発表資料を閲覧することが可能になります。

-研究会設立主旨-

近年 MEMS の市場は、予想以上の確実な伸びを示しています。その状況で、技術の方向性として集積化がキーワードとなっています。集積化の目的として、MEMS の集積化、CMOS-LSI との集積化などさまざまな提案がされています。特に、世界的潮流として、MEMS 技術と LSI 技術との融合は、重要な課題であり More than Moore の一つの解として期待され研究開発が活発化しています。

一方で、MEMS 技術については、材料、プロセス、デバイス構造、実装技術、高歩留り技術、高信頼化技術等多くの課題が顕在化してきています。MEMS 技術の創世期は、MEMS 技術が LSI 技術で培った半導体加工技術の導入により機械工学的な駆動部分や微細構造体を実現するという形で展開されて来ていますが、集積化とビジネス化に至り LSI 技術のあらゆる分野の導入が不可欠になってきたと考えられます。まさに、機械工学と電気電子工学の新たな融合が必要になってきたと考えます。

このような背景において、LSI 技術者が一同に会す応用物理学会の場に集積化 MEMS 技術研究会を設立し MEMS と LSI 両技術分野の融合と新たなテーマに向けた研究活動の場を提供し国内の産業および学術に貢献したいと考えています。特に、MEMS 技術における「これからの真の集積化」の推進を MEMS、LSI の観点 から進め、学問的見地から実用化にいたるまで課題を見極め今後の MEMS の基盤構築を目指します。また、各学会との連携を図り、研究会を通じて広く人的ネットワークの裾野を広げ、産業界、大学含めた連携の基盤づくりを目指します。

-入会案内-

集積化MEMS技術研究会では、会員を募集しています。個人会員と賛助会員(法人)があり、個人会員には A 会員(応物会員以外)と B 会員(応物会員)、学生会員があります。A 会員、B 会員の年会費は 3,000 円、学生会員の年会費は無料、賛助会員の年会費は 20,000 円となります。入会費は A 会員が 1,000 円、B 会員と学生会員、賛助会員の入会費は無料です。会員の方には、研究会主催の企画等をご連絡いたします。

-申し込み方法-

- 個人会員(A 会員、B 会員、学生会員)での入会ご希望の場合は、下記の入会申込フォームに必要事項をご記入の上、お申し込み下さい。お申し込み受信後、会員番号を電子メールにて送付致します。

個人会員用入会申込フォーム: <https://forms.gle/Wa5Ho3Lu6wXHWrsr5>

- 賛助会員での入会ご希望の場合は、下記の①から⑦までの必要事項をご記入の上、入会用電子メールアドレス (integmems-entry-staff@mlist.ne.jp)宛にお申込みください。お申し込み受信後、会員番号を電子メールにて送付し、請求書をお送りいたします。

- ① 会社名:
- ② 会社 HP アドレス(リンクを希望する場合):
- ③ 参加代表者 1 名の氏名:
- ④ 参加代表者 1 名の所属:
- ⑤ 参加代表者 1 名の住所:
- ⑥ 参加代表者 1 名の電子メール:
- ⑦ 参加代表者 1 名の:TEL/FAX:

* 参加者が研究会に応じて変更となること、及び研究会への参加が3名までは可能です。

なお、企画等のご連絡は、参加代表者の方へ差し上げます。

